Beams & Plasmas
Лаборатория вакуумных технологий плюс

Ионный источник L400

ЛЦМК.228.00.00.00

Протяженный ионный источник ИИ-400 - газоразрядный источник ионов рабочего газа с энергией 300-2500 эВ. Принцип действия - ускоритель с анодным слоем (УАС).

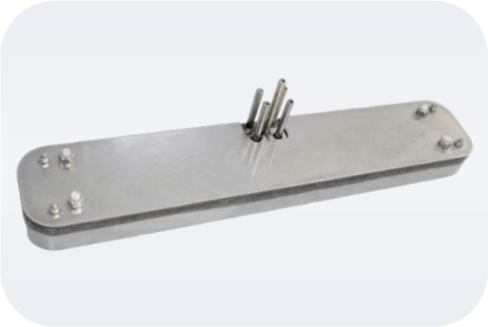
ИИ-400 предназначен для широкого спектра применений: ионной очистки, травления, полировки, модификации поверхности.

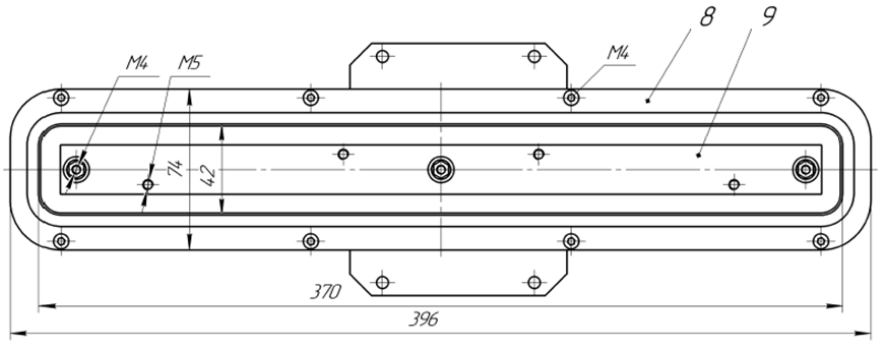
Параметр	Значение
Форма пучка	прямоугольный, полый
Размер пучка (Д x Ш x Т), мм *(Длинна x Ширина x Толщина)	370 x 42 x 5
Напряжение питания, В	500 – 5000
Максимальное напряжение, В	5500
Максимальный ток пучка, mA	600
Максимальный рабочий ток, mA	1000
Максимальный расход газа, л/ч	5,0
Максимальный расход ОЖ, 1 л/мин	1
Максимальное рабочее давление в камере, Па	10
Диапазон рабочих давлений в камере, Па	0,001-1
Масса, кг	не более 6

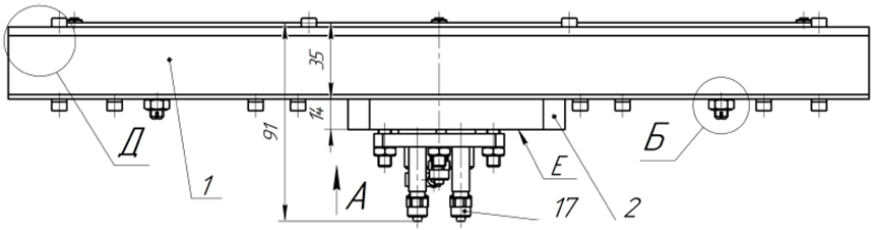
* Он выпускается в нескольких вариантах исполнения.

Beams & Plasmas
Лаборатория вакуумных технологий плюс

Ионный источник L400







ЛЦМК.228.00.00.00